

1 施設使用料:13施設(1時間当たりの金額:円)

施設名	金額
大会議室(108席)	<u>3,000</u>
中研修室(42席)	1,300
小研修室(20席)	600
産学交流室(30席)	1,100
小会議室(12席)	550
3m法電波暗室	<u>3,900</u>
10m法電波暗室	<u>11,000</u>
実用化研究室	<u>300</u>
クリーンルーム	<u>2,200</u>
シールドルーム	<u>350</u>
車載EMC用シールドルーム	800
講師控室	300
フォークリフト	<u>1,100</u>

使用にあたっての注意事項

- 1 はじめに施設等使用条件(URLは下記QRコードから)をお読みになり、承諾のうえ使用を申請してください。
- 2 使用時間が1時間に満たない場合、1時間に切り上げます。
- 3 本表は平日午前9時から午後5時までに適用されます。時間外の使用料及び手数料は、2割を加算した額になります。



2 機器使用料:205機器(1時間当たりの金額:円)

精密測定関連機器(10機器)	金額
工具顕微鏡	<u>550</u>
三次元座標測定機	<u>6,700</u>
真円度測定機	1,000
超精密表面粗さ測定機	1,000
非接触三次元表面粗さ測定機	1,400
表面粗さ・形状測定機	<u>2,500</u>
非接触三次元測定機	1,600
非接触三次元平面度測定機	550
超精密非接触三次元形状評価装置	<u>550</u>
ワンショット測定顕微鏡	<u>600</u>

材料加工関連機器(50機器)	金額
加工特性評価システム	<u>5,400</u>
カットオフマシン	550
機械的特性評価試験機	<u>5,900</u>
高温焼成実験炉	<u>1,500</u>
射出成形機	<u>3,700</u>
スライディングマシン	<u>850</u>
ツインロックウェル硬さ試験機	550
電気炉	<u>700</u>
熱間等方圧プレス	<u>1,700</u>
引張圧縮試験機	650

材料加工関連機器(50機器)	金額
複合材料作製用オートクレーブ	<u>650</u>
粉碎機	<u>550</u>
放電プラズマ焼結機	<u>10,100</u>
真空ホットプレス(VHP)	<u>6,700</u>
マイクロスコープ	<u>1,100</u>
マイクロスライサー	<u>1,300</u>
超精密CNC成形平面研削盤	<u>3,300</u>
高速NCフライス盤	<u>2,300</u>
大型ホットプレス	<u>3,100</u>
加圧型ニーダー	<u>900</u>
スーパーミキサー	550
ビッカース硬度計	600
微小硬度計	700
粒度分布測定器	1,600
気流式粉碎機	<u>1,800</u>
五軸マシニングセンタ	<u>4,200</u>
電子顕微鏡試料作成用スライサー	350
メルトインデックサ	550
超音波厚さ計	900
衝撃試験装置	700
高分子材料コンパウンド装置	<u>4,600</u>
クリープ試験機	<u>650</u>
樹脂流動解析ソフトウェア	<u>1,100</u>

材料加工関連機器(50機器)	金額
工具評価用電子顕微鏡	1,100
高速引張圧縮試験機	<u>1,300</u>
光沢計	400
分光色彩計	400
分光変角色差計	400
3D超音波検査装置	<u>1,900</u>
平面研削盤	<u>2,100</u>
超音波援用加工装置	1,200
ハイスピードカメラ	<u>1,400</u>
マイクロスコープ(DMS1000)	500
自動研磨機	500
精密自動切断機	<u>550</u>
振動研磨機	500
ダイヤモンドワイヤーソー	1,000
送風定温恒温器	500
100kN引張圧縮試験機	<u>1,600</u>
100kN引張圧縮試験機用恒温槽	<u>1,000</u>

電子・情報関連機器(47機器)	金額
静電気放電イミュニティ試験装置	800
デジタルオシロスコープ	<u>600</u>
電圧ディップ瞬時電圧変動試験装置	750
電源高調波・フリッカ測定装置	<u>550</u>
電源周波数磁界イミュニティ試験装置	1,200
LCRメータ	500
インピーダンスアナライザ	500
薄膜透磁率測定システム	550
FEM磁場シミュレータ	550
3m法電波暗室測定システム	<u>4,700</u>
伝導EMC試験システム	<u>2,100</u>
10m法放射エミッション測定システム	<u>5,600</u>
アンテナ照射試験システム	<u>5,000</u>
車載機器用イミュニティ試験システム	<u>3,700</u>
FTB試験装置	1,000
電気安全規格試験装置	800
過渡エミッション測定装置	<u>1,500</u>
インパルスノイズ試験装置	1,000
ガウスメータ	550
ベクトルネットワークアナライザ(Ⅰ)	1,800

電子・情報関連機器(47機器)	金額
任意波形発生器	550
超低温恒温恒湿槽	<u>600</u>
測定機能付精密電流・電圧源(ソースメータ)	<u>650</u>
熱衝撃試験機	<u>650</u>
BCI試験システム	2,000
車載機器用伝導エミッション測定装置	<u>1,900</u>
車載機器用放射エミッション測定装置	1,300
電磁界可視化システム	1,500
熱ナノインプリント装置	<u>1,600</u>
顕微鏡機能付き赤外線サーモグラフィ	550
通信プロトコル解析機能付きデジタルオシロスコープ	550
振動試験装置	<u>2,500</u>
複合環境試験用恒温恒湿槽	<u>1,200</u>
車載機器用試験電源	<u>800</u>
二次元色彩輝度計	1,400
過渡サージ試験装置	1,600
雷サージ試験装置	<u>750</u>
ベクトルネットワークアナライザ(Ⅱ)	800
ポータブル3Dデジタイザ	1,300
磁場中熱処理装置	1,300
カー効果顕微鏡	1,100
振動試料型磁力計	<u>3,000</u>
電源ノイズアナライザ	1,400
リアルタイムスペクトラムアナライザ(Ⅱ)	<u>1,700</u>
外観検査用AIシステム	1,200
ハイパースペクトルカメラ	2,400
非接触画像光学式三次元デジタイザ(FLARE)	2,800

工業デザイン関連機器(12機器)	金額
CAEシステムワークステーション	2,300
真空注型機	550
光造形システム(Ⅲ)ipro	<u>4,100</u>
ウェットブラスト装置	1,100
レーザーカッターシステム	<u>2,700</u>
三次元CADシステム	650
CAD連携CAEシステム	700
UVプリンター	1,800

工業デザイン関連機器(12機器)	金額
エンジニアリングプラスチック造形システム	1,600
アーム式デジタイザ(ベクトロン)	2,300
流体CAEシステム	3,100
CAE検証用計測システム	850

食品・バイオテクノロジー関連機器(43機器)	金額
乾燥機	250
真空ガス置換包装機	550
生物顕微鏡システム	550
窒素分析装置	550
超低温フリーザー	350
融砕機(マスコロイダ)	550
ロータリーエバポレータ	600
クリーンベンチ(MHE-130AJ)	550
恒温振とう器	550
遠心分離機	550
テクスチャー評価装置	550
滅菌用オートクレーブ	550
味評価装置	1,400
飽和蒸気調理機	800
蛍光マイクロプレートリーダー	1,200
インキュベータ	300
サイレントカッター	550
卓上型万能高速カッター・ミキサー	550
食品脱水機	500
腸詰機	500
スチームコンベクションオーブン	950
両面焼成調理機	550
卓上型小型包あん機	500
小型レトルト殺菌装置	550
減圧加熱調理機	450
缶詰巻き締め機	400
食品熱量測定装置(Ⅰ)CA-HN	550
恒温恒湿槽	300
高速液体クロマトグラフ(Chromaster)	1,100
ヘッドスペースガスクロマトグラフ(HS20/GC2030)	1,800
吸光マイクロプレートリーダー	450
水分活性測定装置	500

食品・バイオテクノロジー関連機器(43機器)	金額
食品熱量測定装置(Ⅱ)CA-HM	1,000
紫外可視分光光度計	500
モバイル分光測色計	350
大型オートクレーブ	300
サーマルタンク500	250
クリーンベンチ(VSF-1301)	200
酒造用タンク360	200
真空凍結乾燥機	800
オートサンプラー付GC-MS/O	2,100
高速液体クロマトグラフ(1260Infinity)	1,100
デュアルカラム高速GC	4,000

分析・測定関連機器(43機器)	金額
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF)	2,100
誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-OES)	4,000
X線光電子分光分析装置(XPS-Nexsa)	8,100
微小部蛍光X線分析装置(μ -XRF)	3,100
熱分析システム(TG/DTA, DSC, TMA, DMA)	1,100
電子天秤	300
接触角計	1,100
蛍光分光光度計	500
電界放出型電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	5,400
レーザー顕微鏡	1,300
ガスクロマトグラフ	550
超高速液体クロマトグラフ質量分析システム	2,900
フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)	1,400
多目的X線回折装置(XRD)	3,500
走査型電子顕微鏡	4,600
イオン研磨装置	1,300
倒立型金属顕微鏡	1,000
加熱加圧埋込機	850
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)	3,100
スパーク放電発光分光分析装置	2,100
ラマン分光光度計	3,400
レオメーター(MCR302)	1,900

分析・測定関連機器(43機器)	金額
PCRサーマルサイクラ	200
冷却遠心分離機	250
微量分光光度計	250
電気泳動ゲル撮影装置	300
アンプル用凍結乾燥装置	300
アンプル熔閉器	200
波長分散型蛍光X線分析装置(WDXRF)	3,900
ガラスビード作製装置	1,500
紫外可視近赤外分光光度計	900
高温対応微弱発光検出装置 (HT-CLA)	1,000
シャルピー衝撃試験機 (シャルピー)	950
マイクロフォーカスX線CT装置	3,200
マイクロフォーカスX線透過装置	1,900
ポータブル型X線残留応力測定装置	1,000
サブミクロン三次元X線顕微鏡(XRM)	6,300
卓上型高速X線CT装置(高速XCT)	3,800
3Dひずみ計測システム	2,000
B型粘度計	500
カールフィッシャー水分計(KF水分計)	2,600
マイクロ波分解装置	2,100
卓上低真空SEM	3,000

3 その他の手数料(金額:円)

区分	金額
研究員技術的支援手数料	4,000
研修員受入手数料	3,600
試験等手数料別紙「試験等手数料表」のとおりに	—

電子版料金表はこちら



申請書ダウンロードはこちら

